### 03,09

# Диффузия магния в кремнии, выращенном методом Чохральского

© Л.М. Порцель, Ю.А. Астров, А.Н. Лодыгин

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия E-mail: leonid.portsel@mail.ioffe.ru

Поступила в Редакцию 23 мая 2024 г. В окончательной редакции 23 мая 2024 г. Принята к публикации 24 мая 2024 г.

Исследована диффузия магния в бездислокационном кремнии, выращенном методом Чохральского (Cz-Si) с концентрацией кислорода  $\sim (1.2-1.6) \cdot 10^{17} \, {\rm cm}^{-3}$ . Проведено сравнение температурной зависимости коэффициента диффузии магния с данными, полученными ранее в Cz-Si с бо́льшей концентрацией кислорода  $\sim (3-4) \cdot 10^{17} \, {\rm cm}^{-3}$ . Значения коэффициента диффузии, измеренные при температурах  $T = 1100-1250^{\circ}$  С, оказались больше в кремнии с меньшей концентрацией кислорода. Обработка экспериментальных данных проводилась в рамках модели диффузии ограниченной ловушками, в которой замедление диффузии происходит в результате захвата межузельных атомов Mg центрами, связанными с кислородом. Определена энергия связи центров захвата  $\sim 2.2 \, {\rm eV}$ .

Ключевые слова: кремний, выращенный методом Чохральского, магний, диффузия, глубокие доноры.

DOI: 10.61011/FTT.2024.07.58390.133

### 1. Введение

Интерес к глубоким донорам в кремнии обусловлен как квантовой структурой этих центров, так и возможным их применением в качестве активных сред для лазерной генерации на внутрицентровых оптических переходах [1]. Использование глубоких примесей открывает перспективы создания источников излучения в средневолновой области спектра, и кремний легированный магнием Si: Mg является одним из таких материалов [2–5].

Электрически активные атомы магния  $Mg_i$  занимают межузельное положение в решетке кремния и образуют двойной донорный центр с уровнями энергии  $E_C - 0.107 \text{ eV}$  нейтрального  $Mg_i^0$  и  $E_C - 0.256 \text{ eV}$  однократно ионизованного состояния  $Mg_i^+$ , соответственно [6,7]. Концентрация центров  $N_{Mg_i}$  составляет  $\sim (1.0-1.5) \cdot 10^{15} \text{ cm}^3$ . Вследствие взаимодействия с другими примесями магний образует в запрещенной зоне кремния различные донорные уровни. Это комплексы Mg с акцепторами замещения B, Al, Ga, In, междоузельным Li, и множество других донорных центров (см. обзор [8]). Взаимодействие Mg с кислородом приводит к образованию комплекса Mg-O [9,10]. Также как Mg, этот комплекс представляет интерес для использования в ИК-фотонике.

В работе [11] было проведено исследование диффузии Mg в бездислокационном кремнии *n*-типа, выращенном методом Чохральского (Cz-Si), с концентрацией кислорода  $\sim (3-4) \cdot 10^{17}$  cm<sup>-3</sup>. Выбор такого материала был связан с предполагаемой возможностью получения высокой концентрации комплекса Mg-O. Была определена зависимость коэффициента диффузии магния от температуры  $D_{Mg}(T)$  в интервале  $T = 1100-1250^{\circ}$ С. Обнару-

жено существенное снижение  $D_{Mg}(T)$  на 2–3 порядка величины в Cz-Si по сравнению с соответствующими значениями в бескислородном кремнии, выращенном методом зонной плавки (Fz-Si). Было высказано предположение, что диффузия в Cz-Si замедляется за счет захвата межузельных атомов Mg ловушками, связанными с кислородом. Экспериментальные результаты анализировались в рамках модели диффузии ограниченной ловушками (trap-limited diffusion). Определена энергия связи центров захвата ~ 2.3 eV.

Настоящая работа является продолжением исследования, проведенного в [11] и направлена на дальнейшее изучение диффузии межузельных атомов магния в кремнии, содержащем центры захвата.

Для проведения диффузии Mg, в качестве исходного материала был выбран Cz-Si с концентрацией кислорода меньше, чем в цитируемой выше работе. Коэффициент диффузии определялся из профиля концентрации электрически активных центров магния  $N_{\rm Mg}$  в образцах, полученных в результате проведения процесса при температурах  $T = 1100 - 1250^{\circ}$ C.

Сравнение результатов настоящей работы с параметрами центров захвата, определенными в [11], позволило проверить концепцию диффузии Mg в присутствии центров захвата и применимость используемой модели для обработки данных.

### 2. Методика эксперимента

Легирование кремния проводилось "сандвич"-методом диффузии [8,12]. В качестве исходного материала использовались пластины Cz-Si *n*-типа (КЭФ) с удельным сопротивлением  $\rho \sim 100-120 \,\Omega \cdot \text{сm}$ . Концентрации кислорода и углерода в исходном кремнии определя-

лись при комнатной температуре по пикам поглощения атомарного кислорода  $1106~{\rm cm^{-1}}$  и углерода  $605~{\rm cm^{-1}}$ с помощью Фурье-спектрометра FSM2201. Концентрация кислорода составляла  $\sim (1.2-1.6) \cdot 10^{17}~{\rm cm^{-3}}$  и  $\sim (1.2-1.5) \cdot 10^{17}~{\rm cm^{-3}}$  углерода, соответственно.

Введение примеси в Si осуществлялось в два этапа. На первом этапе проводились все подготовительные операции, необходимые для "сандвич" метода диффузии [12]. На одну сторону пластины исходного кремния диаметром ~ 30 mm и толщиной  $d \approx 1.2-2.0$  mm напылялась пленка магния чистотой ~ 99.995%. Затем плоскость образца с нанесенным магнием накрывалась вспомогательной пластинкой кремния толщиной ~ 0.4-0.5 mm. Такой "сандвич" помещался в кварцевую ампулу, которая заполнялась аргоном и отпаивалась. Прогрев ампулы осуществлялся в течение 30 min при температуре 1100°С, что приводило к свариванию материала образца и вспомогательной пластинки через слой магния.

Затем "сандвич" доставался из ампулы, и из него вырезались образцы размером  $10 \times 10$  mm. Такие образцы помещались в тонкостенные кварцевые ампулы малого диаметра 15-16 mm, которые заполнялись аргоном и отпаивались. Диффузия магния проводилась при температурах T = 1100-1250°C в течение 7.5 h. По окончании процесса, легируемый образец закаливался сбрасыванием ампулы в минеральное масло. Высокая скорость охлаждения обеспечивалась использованием тонкостенных ампул и малыми размерами образцов. После закалки вспомогательная пластинка кремния удалялась шлифованием.

Коэффициент диффузии межузельного магния  $D_{Mg}$  определялся путем измерения профиля концентрации электронов методом дифференциальной проводимости [12]. Для этого находилось распределение удельной проводимости по толщине образца с помощью последовательного удаления слоев кремния  $\sim 20 \,\mu$ m. Поверхностная проводимость образца измерялась четырехзондовым методом до и после удаления слоя. Распределение удельной проводимости аппроксимировалось аналитической функцией, которая использовалась для расчета профиля концентрации электронов *n*.

На рис. 1 приведен пример профиля *n* в образце Si:Mg, легированного при  $T = 1100^{\circ}$ C в течение 7.5 h. Концентрация электронов уменьшается с глубиной образца и при  $d > 300\,\mu$ m наблюдается почти постоянное значение  $n_P \approx 4.9 \cdot 10^{13}$  cm<sup>-3</sup>. Эта величина соответствует концентрации электронов полностью ионизованной примеси фосфора в исходном кремнии с  $\rho \approx 100 \,\Omega \cdot$  cm и отмечена на графике пунктирной линией.

Концентрация электронов, обусловленная ионизацией донорных центров Mg, может быть получена вычитанием значения  $n_P$  из n. Распределение концентрации атомов магния  $N_{\rm Mg}$  по глубине образца определялось из профиля скорректированного значения концентра-



**Рис. 1.** Профили концентрации электронов *n* и центров магния  $N_{\rm Mg}$  в образце, полученном диффузией при температуре  $T = 1100^{\circ}$ С в течение 7.5 h. Горизонтальная пунктирная линия соответствует концентрации электронов в исходном *n*-Si с удельным сопротивлением  $\rho \approx 100 \,\Omega \cdot {\rm cm}$ . Сплошная кривая показывает профиль теоретической зависимости диффузии  $N_{\rm Mg}$  с коэффициентом  $D_{\rm Mg} = 2.5 \cdot 10^9 \,{\rm cm}^2 {\rm s}^{-1}$ .

ции электронов с помощью калибровочной зависимости  $N_{Mg}(n)$ .

Эта зависимость определялась путем численного решения уравнения электронейтральности для кремния, содержащего двойной донорный центр Mg, компенсированный мелким акцептором. Энергии Mg<sup>0/+</sup> состояний соответствовали значениям, указанным во введении, а заряд примеси определялся статистикой заполнения электронами состояний центра при комнатной температуре (см. Suppl. Material к статье [13]). Значения  $N_{\rm Mg}$ отмечены на графике символами. Сплошная кривая на рисунке — результат подгонки теоретической зависимости диффузии примеси из неограниченного источника, к совокупности экспериментальных точек. Такая процедура позволила оценить значение коэффициента диффузии —  $D_{\rm Mg} = 2.5 \cdot 10^{-9} \, {\rm cm}^2 {\rm s}^{-1}$ .

## Результаты измерений и обсуждение

Для определения температурной зависимости коэффициента диффузии магния  $D_{Mg}(T)$  были проведены процессы при температурах 1100, 1150, 1200 и 1250°С. На графике рис. 2 представлены значения  $D_{Mg}(T)$ , полученные в результате обработки экспериментальных данных по вышеизложенной методике. Как было отмечено, концентрация кислорода в исходном Cz-Si составляла ~  $(1.2-1.6) \cdot 10^{17}$  сm<sup>-3</sup>. Для сравнения на графике показана температурная зависимость коэффициента диффузии магния  $D_{CZ}(T)$  в Cz-Si с концентрацией кислорода ~  $(3-4) \cdot 10^{17}$  сm<sup>-3</sup> [11]. Построена также температур-



**Рис. 2.** Температурные зависимости коэффициента диффузии магния в кремнии. Символы соответствуют экспериментальным значениям  $D_{Mg}(T)$  в Fz-Si [12], в Cz-Si с концентрацией кислорода  $\sim (3-4) \cdot 10^{17}$  cm<sup>-3</sup> [11] и  $\sim 1.4 \cdot 10^{17}$  cm<sup>-3</sup> — данные настоящей работы. Сплошные линии — результат расчета  $D_{Mg}(T)$  в Fz-Si по формуле (1), в Cz-Si по формуле (3) с параметрами, указанными в тексте.

ная зависимость коэффициента диффузии Mg  $D_{FZ}(T)$  в бескислородном кремнии, выращенном методом зонной плавки (Fz-Si) [12]. Как видно из сопоставления экспериментальных данных, значения коэффициентов диффузии в Cz-Si на несколько порядков меньше, чем в бескислородном Fz-кремнии. Уменьшение концентрации кислорода в исходном кремнии приводит к увеличению коэффициента диффузии Mg.

Температурная зависимость  $D_{\rm FZ}(T)$  в Fz-Si была определена в [12] как

$$D_{\rm FZ}(T) = D_{\rm 0FZ} \exp(-E_{\rm FZ}/k_{\rm B}T), \qquad (1)$$

где  $D_{0FZ} = 5.3 \text{ cm}^2 \text{s}^{-1}$  — предэкспоненциальный множитель,  $E_{FZ} = 1.83 \text{ eV}$  — энергия активации диффузии,  $k_{\text{B}}$  — постоянная Больцмана. В работе [11] были получены параметры зависимости Аррениуса  $D_{CZ}(T)$  в Cz-Si:  $D_{0CZ} = 7.7 \cdot 10^5 \text{ cm}^2 \text{s}^{-1}$ , и  $E_{CZ} = 4.1 \text{ eV}$ . Обработка экспериментальных данных  $D_{\text{Mg}}(T)$  настоящей работы, дала следующие значения предэкспоненциального множителя:  $D_0 = 1.7 \cdot 10^6 \text{ cm}^2 \text{s}^{-1}$  и энергии активации диффузии  $E_m = 4.03 \text{ eV}$ .

Как было отмечено во введении, экспериментальные результаты работы [11] анализировались в рамках модели диффузии ограниченной ловушками. Термины "центр захвата" или "ловушка" используются для обозначения области в кристалле, в которой потенциальная энергия атомов меньше по сравнению с энергией в междоузлиях решетки. Понижение потенциальной энергии в этой области может быть вызвано искажением решетки структурными дефектами или взаимодействием с примесями, имеющими высокое сродство к межузельным атомам. Для движения в кристалле, атомы должны преодолеть энергетический барьер  $E_m$  — энергия активации диффузии. Для попадания в ловушку — барьер такой же, как для движения, но, чтобы освободится, атомы должны преодолеть энергетический барьер  $E_m + E_B$ , где  $E_B$  — энергия связи, дополнительная энергия необходимая для выхода из ловушки.

Традиционный подход к описанию диффузии межузельных атомов примеси в кристалле, содержащем центры захвата, основан на решении системы уравнений реакции—диффузии. В условиях термодинамического равновесия между захваченными и диффундирующими атомами система уравнений может быть сведена к классической форме уравнения диффузии с эффективным коэффициентом  $D^*$  [14–16]. Атомистическая модель диффузии междоузельных атомов при наличии ловушек (atomic model of trapping) была развита в [17]. Обе эти модели дают формально одинаковое выражение для эффективного коэффициента диффузии. В обозначениях [17] температурная зависимость  $D^*(T)$  может быть представлена как

$$D^*(T) = \frac{D(T)}{1 + \alpha C \exp(E_{\rm B}/k_{\rm B}T)},$$
(2)

где D(T) — коэффициент диффузии, в кристалле без ловушек.  $\alpha$  — конфигурационный фактор. C — атомная доля центров захвата (atomic fraction of trapping centers). В ряде работ, которые использовали зависимость (2) для определения  $D^*(T)$ , значение  $\alpha \approx 1$  принималось близким к единице [18,19].

Экспоненциальное выражение в знаменателе формулы (2) в модели реакции-диффузии соответствует отношению концентрации атомов, захваченных на ловушки, к равновесной концентрации межузельных атомов. В атомистической модели — отношению усредненного времени нахождения атомов на ловушках к времени свободного движения в кристалле.

Как видно из графика рис. 2, отношение коэффициентов диффузии Mg в Fz and Cz-Si составляет несколько порядков величины. Поэтому можно пренебречь единицей в знаменателе (2). Тогда, после подстановки (1) в (2) температурная зависимость коэффициента диффузии Mg в Cz-Si выражается как

$$D_{\rm Mg}(T) = \frac{D_{\rm 0FZ}}{\alpha C} \exp\left(-\frac{E_{\rm FZ} + E_{\rm B}}{k_{\rm B}T}\right).$$
 (3)

Энергия связи центров захвата  $E_{\rm B}$ , таким образом, равна разности энергий активации диффузии магния в Cz-Si  $(E_m)$  и в кремнии без ловушек Fz-Si  $(E_{\rm FZ})$ :  $E_{\rm B} = E_m - E_{\rm FZ} = 2.2$  eV. Значение атомной доли центров захвата равно  $\alpha C = D_{0\rm FZ}/D_0 = 3.1\cdot10^{-6}$ . В кремнии с высокой концентрацией кислорода, который использовался в экспериментах [11] —  $\alpha \cdot C = 6.9\cdot10^{-6}$ . Сплошные линии на графике рис. 2, проходящие через точки экспериментальных данных, соответствуют рассчитанной по формуле (3) зависимости  $D_{Mg}(T)$  с указанными выше параметрами.

Концентрацию центров захвата в кристалле  $N_{TR}$  можно оценить, умножив значение атомной доли на число атомов кремния  $N_{TR} = \alpha \cdot C \times 5.0 \cdot 10^{22} \, {\rm cm}^{-3}$ . Так для кремния, который использовался в [11],  $N_{TR} \approx 3.5 \cdot 10^{17} \, {\rm cm}^{-3}$ , а для КЭФ кремния данной работы  $N_{TR} \approx 1.5 \cdot 10^{17} \, {\rm cm}^{-3}$ . Эти значения по порядку величины соответствуют концентрациям кислорода, определенным по спектрам поглощения в разных кристаллах.

Как отмечалось в [11], значение энергии связи  $\sim 2.2 \text{ eV}$  значительно больше соответствующих энергий, наблюдаемых в экспериментах по замедлению диффузии межузельных атомов других примесей в кремнии. Так, при образовании донорно-акцепторных пар (B-Cu) энергия связи составляет порядка  $\sim 0.5 \text{ eV}$  [20]. Значение  $E_{\rm B} \approx 0.9 \text{ eV}$  соответствует захвату диффундирующих междоузельных атомов Pb структурными дефектами в аморфном Si [18].

Центры захвата с энергией связи ~ 2.3 eV и концентрацией ~  $1.5 \cdot 10^{17}$  cm<sup>-3</sup> были обнаружены при исследовании диффузии межузельных атомов Si в легированных бором сверхрешетках, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии [19]. По мнению авторов, такие ловушки могут быть связаны с примесями кислорода О или углерода С, растворенными в кристалле.

### 4. Заключение

В ходе экспериментов определена температурная зависимость коэффициента диффузии магния  $D_{Mg}(T)$ Cz-Si концентрацией В с  $\sim (1.2{-}1.6) \cdot 10^{17} \, cm^{-3}$ кислорода И углерода  $\sim (1.2{-}1.5) \cdot 10^{17}\, \text{cm}^{-3}.$  Проведено сравнение результатов настоящего исследования с результатами работы [11], в которой изучалась диффузия Mg в Cz-Si с большей, чем в данной работе концентрацией кислорода  $\sim (3-4) \cdot 10^{17} \, {\rm cm}^{-3}$ . Показано, что уменьшение концентрации кислорода в исходном кремнии приводит к увеличению значения  $D_{Mg}(T)$ . Концентрация центров захвата, определенная из экспериментальных значений предэкспоненциальных множителей функции Аррениуса для Cz-Si и Fz-Si, незначительно отличается от концентрации кислорода в исходных для диффузии материалах. Энергия связи центров захвата составила  $\sim 2.2\,\mathrm{eV}$  и совпадает в пределах погрешности измерений со значением, определенном в работе [11]. Эти факты подтверждают предположение, что центры захвата атомов Мg связаны с растворенным в кристалле кислородом.

#### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

### Список литературы

- S.G. Pavlov, R.Kh. Zhukavin, V.N. Shastin, H.-W. Hübers. Phys. Status Solidi B 250, 1, 9 (2013).
- [2] N.V. Abrosimov, N. Nötzel, H. Riemann, K. Irmscher, S.G. Pavlov, H.-W. Hübers, U. Böttger, P.M. Haas, N. Drichko, M. Dressel. Solid State Phenomena 131–133, 589 (2008).
- [3] S.G. Pavlov, N. Deßmann, A. Pohl, V.B. Shuman, L.M. Portsel, A.N. Lodygin, Yu.A. Astrov, S. Winnerl, H. Schneider, N. Stavrias, A.F.G. van der Meer, V.V. Tsyplenkov, K.A. Kovalevsky, R.Kh. Zhukavin, V.N. Shastin, N.V. Abrosimov, H.-W. Hübers. Phys. Rev. B 94, 075208 (2016).
- [4] В.Н. Шастин, Р.Х. Жукавин, К.А. Ковалевский, В.В. Цыпленков, В.В. Румянцев, Д.В. Шенгуров, С.Г. Павлов, В.Б. Шуман, Л.М. Порцель, А.Н. Лодыгин, Ю.А. Астров, Н.В. Абросимов, Ј.М. Кlopf, Н.W. Hübers. ФТП 53, 9, 1263 (2019).
- [5] Н.А. Бекин, Р.Х. Жукавин, В.В. Цыпленков, В.Н. Шастин. ФТП **58**, *1*, 7 (2024).
- [6] R.K. Franks, J.B. Robertson. Solid State Commun. 5, 6, 479 (1967).
- [7] L.T. Ho, A.K. Ramdas. Phys. Rev. B 5, 2, 462 (1972).
- [8] Yu.A. Astrov, L.M. Portsel, V.B. Shuman, A.N. Lodygin, N.V. Abrosimov. Phys. Status Solidi A 219, 2200463 (2022).
- [9] A. Thilderkvist, M. Kleverman, H.G. Grimmeiss, Phys. Rev. B 49, 16338 (1994).
- [10] L.T. Ho. Phys. Status Solidi B 210, 313 (1998).
- [11] L.M. Portsel, A.N. Lodygin, N.V. Abrosimov, Yu.A. Astrov. Phys. Status Solidi A 220, 2300130 (7p) (2023).
- [12] В.Б. Шуман, Ю.А. Астров, А.Н. Лодыгин, Л.М. Порцель. ФТП 51, 8 1075 (2017).
- [13] S.G. Pavlov, L.M. Portsel, V.B. Shuman, A.N. Lodygin, Y.A. Astrov, N.V. Abrosimov, S.A. Lynch, V.V. Tsyplenkov, H.-W. Hübers. Phys. Rev. Mater. 5, 114607 (2021).
- [14] C.A. Wert, R.C. Frank. Ann. Rev. Mater. Sci., 13, 139 (1983).
- [15] P.M. Fahey, P.B. Griffin, J.D. Plummer. Rev. Mod. Phys. 61, 289 (1989).
- [16] V.V. Voronkov. Phys. Status Solidi A 216, 20 1900130(7) (2019).
- [17] M. Koiwa, Acta Met. 22, 1259 (1974).
- [18] S. Coffa, J.M. Poate, D.C. Jacobson. Phys. Rev. B 45, 8355 (1992).
- [19] P.A. Stolk, H.-J. Gossmann, D.J. Eaglesham, D.C. Jacobson, J.M. Poate, H.S. Luftman. Appl. Phys. Lett. 66, 568 (1995).
- [20] R. Keller, M. Deicher, W. Pfeiffer, H. Skudlik, D. Steiner, Phys. Rev. Lett., 65, 2023 (1990).

Редактор К.В. Емцев